(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Bureau international

(43) Date de la publication internationale
23 juin 2011 (23.06.2011)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2011/073348 A1

(51) Classification internationale des brevets :
H01L 21/00 (2006.01) *H01L 21/673* (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2010/069973

(22) Date de dépôt international :
16 décembre 2010 (16.12.2010)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
0959235 18 décembre 2009 (18.12.2009) FR

(71) Déposant *(pour tous les États désignés sauf US)* : **ALCATEL LUCENT** [FR/FR]; 3, Avenue Octave Gréard, F-75007 Paris (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants *(pour US seulement)* : **FAVRE, Arnaud** [FR/FR]; Adixen, 98 avenue de Brogny, F-74009 Annecy (FR). **BOUNOUAR, Julien** [FR/FR]; Adixen, 98 avenue de Brogny, F-74009 Annecy (FR).

(74) Mandataires : **SOGAN, Gloria** et al.; Innovincia, 11 avenue des Tilleuls, F-74200 Thonon les Bains (FR).

(81) États désignés *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible)* : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible)* : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

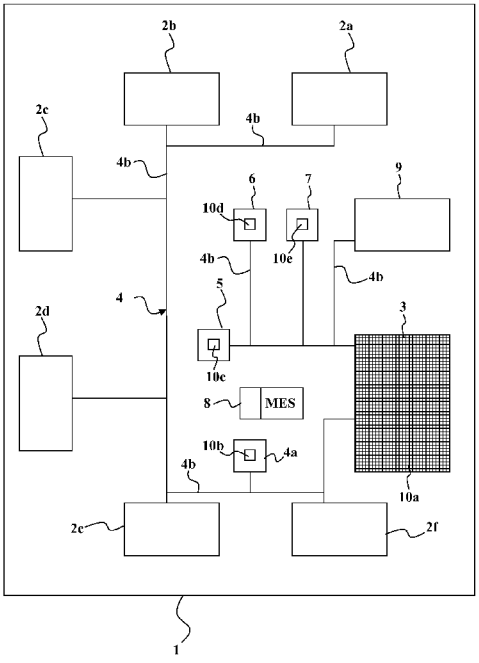
— *avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))*

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : METHOD AND DEVICE FOR CONTROLLING THE MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR BY MEASURING CONTAMINATION

(54) Titre : PROCEDE ET DISPOSITIF DE PILOTAGE DE FABRICATION DE SEMI-CONDUCTEURS PAR MESURE DE CONTAMINATION

FIG. 1



(57) Abstract : The present invention relates to a device for handling substrates in a semiconductor manufacturing plant that has substrate processing facilities, a substrate storage means, a substrate transport means, and a system for controlling manufacturing execution systems (MES) in functional relationship to the substrate processing facilities, the substrate storage means, and the substrate transport means. Said device includes: at least one substrate storage and transport box that is transported by the transport means and stored in the storage means; at least one device for analyzing the gases forming the inner atmosphere of a substrate storage and transport box, said analyzing device producing analysis signals that represent the critical gas amount that is capable of generating molecular contamination and is present in the storage and transport box; and a control device that controls the transport means and storage means, the control device including instructions for detecting a need for molecular decontamination on the basis of analysis signals emitted by the gas-analyzing device.

(57) Abrégé : La présente invention a pour objet un dispositif pour la manutention de substrats dans une usine de fabrication de semi-conducteurs ayant des équipements de traitement de substrats, des moyens de stockage de substrats,

[Suite sur la page suivante]

WO 2011/073348 A1